

第2回 産学公連携コーディネータ研鑽交流会

産学連携、研究の実用化、企業の課題解決を進めるにあたり、産学公のコーディネータの活動がますます重要になってきています。これら人材のネットワーク形成により今後の連携活動を円滑にすすめることを目的にコーディネータ研鑽交流会を開催致します。

今回は、半導体材料およびセンサー、パワーデバイス等の研究の第一人者である京都大学の藤田静雄教授をお招きして研究の最新トピックスや大学発イノベーション実用化の取り組みについてご講演頂きます。藤田教授は「ミストCVD」という新しい半導体製造技術の開発により次世代のパワーデバイスを事業化する京大発のベンチャー企業（株）FLOSFIA（京都市、人羅俊実社長）の立ち上げにも大きく貢献されています。

- 【日時】 平成31年 1月 30日（水） 15:00～17:00（14:30開場） 17:00～18:00（懇親会）
- 【場所】 京都リサーチパーク 東地区1号館4階 G会議室、 レストランパティオ（懇親会）
- 【対象】 大学・産業支援機関のコーディネータおよび企業の新規事業関係者など次世代ビジネスに興味のある方
- 【定員】 40名（申込先着順）
- 【参加費】 無料（懇親会参加者は2,000円を受付にて拝受いたします）
- 【主催】 京都産学公連携機構
- 【プログラム】（暫定）

15:00 -15:10 開会挨拶

15:10 -15:40 講演 「JST(科学技術振興機構)における主な産学連携支援事業」

JST 産学連携展開部 地域イノベーショングループ

マッチングプランナー 長岡 由起氏

15:40 -16:40 招待講演 「環境に優しい材料・成膜技術（ミストCVD）を活かした次世代半導体の開発とその実用化」

京都大学大学院工学研究科 教授 藤田 静雄氏

16:45 閉会（17:00 -18:00 懇親会）

【問い合わせ・申し込み先】:

京都産学公連携機構（石尾）

申し込み締切日：平成31年1月25日（金）

E-mail：sangakukou@kyo.or.jp

招待講演者紹介



藤田 静雄氏

京都大学大学院工学研究科 光・電子理工学教育センター 教授

京都大学大学院工学研究科卒業後、助手、助教授を経て2001年には京都大学の産官学連携拠点である国際融合創造センターに着任し、産官学連携研究活動に取り組みました。知的クラスター創成事業、産学融合アライアンス等の遂行にも関わりました。

ワイドギャップ半導体研究の第一人者で、世界に先駆けて独自に開発した「ミストCVD」により結晶合成された酸化ガリウム (Ga_2O_3) は従来のシリコン(Si)やシリコンカーバイド(SiC)を補完する次世代の超低損失パワーデバイス半導体として大きな期待が寄せられています。この研究成果をもとに設立された京都大学発のベンチャー企業である(株) FLOSFIA (京都市 人羅敏実社長)において様々な電力変換器への搭載を目指して精力的に実用化研究、事業化がすすめられています。

藤田氏は2016年 日経ビジネスの「次代を創る100人」に選出されています。また(株) FLOSFIAの支援大学研究者として国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 大学発ベンチャー表彰2017を受賞しています。

第2回 産学公連携コーディネータ研鑽交流会 申込書

締切日：平成31年1月25日(金)

京都産学公連携機構 宛

E-Mail：sangakukou@kyo.or.jp FAX：075-211-1881



会場案内：京都リサーチパーク(KRP)

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134

会場はKRP 東地区1号館の4階です。

・京都駅よりJR嵯峨野線(山陰本線)

丹波口 駅下車徒歩5分

・京都駅中央口からタクシーで約15分

※下記の個人情報の取り扱いについて確認し、同意した上で参加を申し込みます。

団体名	
電話番号	() —

(ふりがな) 氏名	役職	e-mail	懇親会
()			参加・不参加
()			参加・不参加
()			参加・不参加

《運営事務局より》

●個人情報の取り扱いについて

申込及び本イベントにおいて知り得た貴殿の個人情報は事務局(主催者・共催者)にて管理させて頂き、本イベントの運営や今後運営事務局が主催・共催する催事のご案内等に利用させて頂きます。本人の承諾なしに第三者に提供する事はありません。

●参加証は発行致しません。定員オーバーにて参加不可の場合のみご連絡させて頂きます。